

# イオンビーム工学セミナーのご案内

1. 日時 2011年3月4日(金)
2. 会場 法政大学小金井キャンパス  
西館 W201  
(JR中央線東小金井駅北口下車徒歩12分)

## 3. プログラム

15:00 「GaNへのイオン注入とデバイス応用」  
法政大学  
マイクロナノテクノロジー研究センター  
野本 一貴 氏

16:00 「SiCパワーデバイスのプロセス技術  
～イオン注入から電極形成まで～」  
産業技術総合研究所  
先進パワーエレクトロニクス研究センター  
田中 保宣 氏

事前のお申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

主催・問合せ先

法政大学イオンビーム工学研究所  
〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2  
TEL 042-387-6094 FAX 042-387-6095